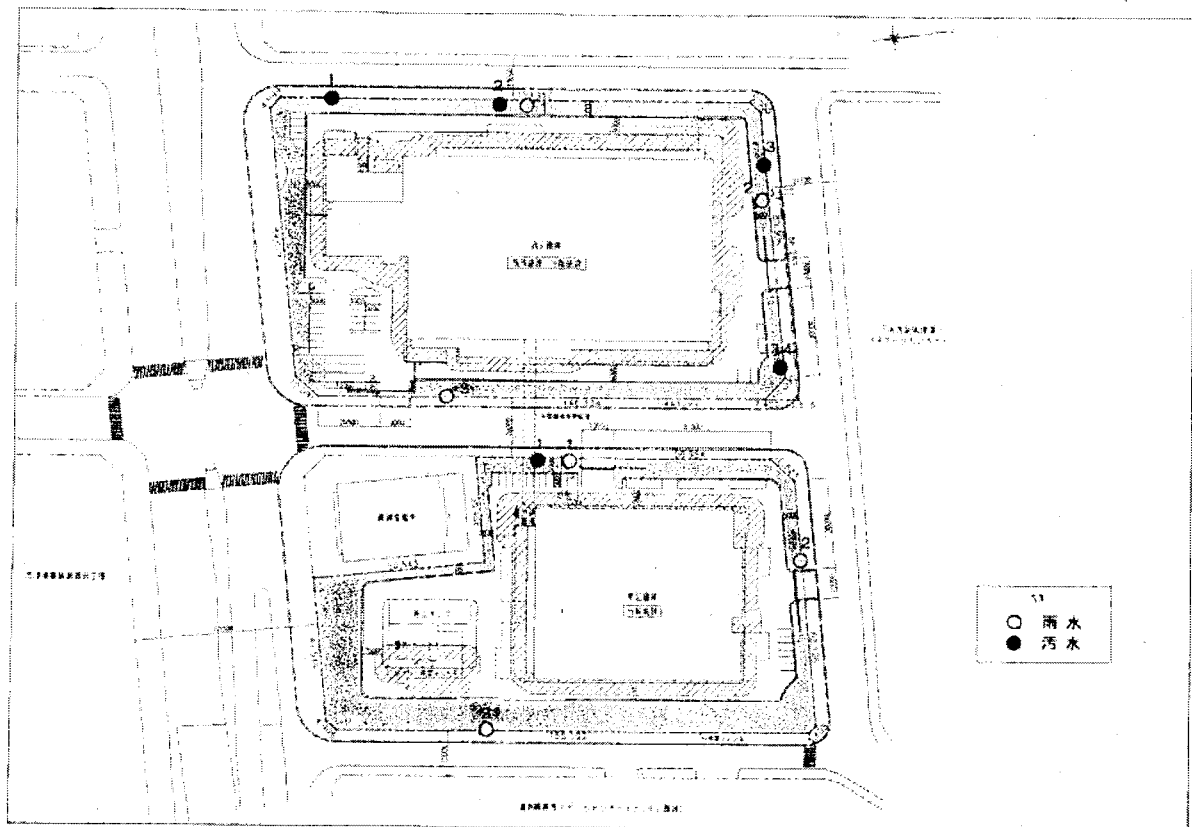


表-1. 排水

棟名		測定項目	結果	維持管理値	自主管理目標値
西棟	敷地境界汚水	① PCB	検出せず mg/L	0.003 mg/L	0.0005 mg/L
		ダイオキシン類	0.65 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	5 pg-TEQ/L
		② PCB	検出せず mg/L	0.003 mg/L	0.0005 mg/L
		ダイオキシン類	1.3 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	5 pg-TEQ/L
		③ PCB	検出せず mg/L	0.003 mg/L	0.0005 mg/L
		ダイオキシン類	0.22 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	5 pg-TEQ/L
	敷地境界雨水	④ PCB	検出せず mg/L	0.003 mg/L	0.0005 mg/L
		ダイオキシン類	0.46 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	5 pg-TEQ/L
		① PCB	検出せず mg/L	0.003 mg/L	0.0005 mg/L
		ダイオキシン類	3.2 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	5 pg-TEQ/L
		② PCB	検出せず mg/L	0.003 mg/L	0.0005 mg/L
		ダイオキシン類	7.0 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	5 pg-TEQ/L
東棟	敷地境界汚水	③ PCB	検出せず mg/L	0.003 mg/L	0.0005 mg/L
		ダイオキシン類	2.7 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	5 pg-TEQ/L
	敷地境界雨水	① PCB	検出せず mg/L	0.003 mg/L	0.0005 mg/L
		ダイオキシン類	13.0 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	5 pg-TEQ/L
		① PCB	検出せず mg/L	0.003 mg/L	0.0005 mg/L
		ダイオキシン類	2.0 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	5 pg-TEQ/L
		② PCB	検出せず mg/L	0.003 mg/L	0.0005 mg/L
		ダイオキシン類	5.1 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	5 pg-TEQ/L
		③ PCB	検出せず mg/L	0.003 mg/L	0.0005 mg/L
		ダイオキシン類	0.79 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	5 pg-TEQ/L

排水中のPCB濃度の定量下限値は、0.0005mg/L



排水サンプリング位置図

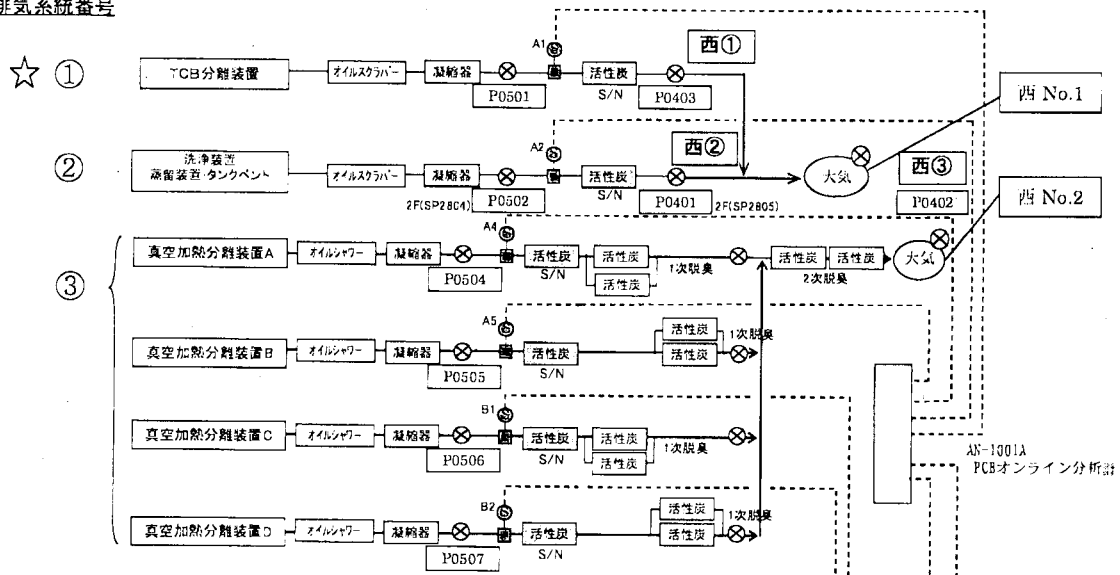
表-2. 排気(排気口、ボイラー)

棟名			測定項目	結果					
				H20.5	H20.3、4	H19.12、H20.1	維持管理値	自主管理目標値	
西棟	①	排気口 西No.1-1 (P0403)	TCB分離装置	PCB ダイオキシン類 塩化水素 ベンゼン	<0.1 ppm	0.000018 mg/m ³ N 0.00012 ng-TEQ/m ³ N 200 ppm <0.05 mg/m ³ N	0.000045 mg/m ³ N 0.00089 ng-TEQ/m ³ N 0.93 ppm <0.05 mg/m ³ N	0.1 mg/m ³ N - - -	0.01 mg/m ³ N 0.1 ng-TEQ/m ³ N 0.61 ppm 0.35 mg/m ³ N
	②	排気口 西No.1-2(P0401)	洗浄装置	PCB ダイオキシン類		0.000064 mg/m ³ N 0.00015 ng-TEQ/m ³ N	0.000020 mg/m ³ N 0.00042 ng-TEQ/m ³ N	0.1 mg/m ³ N -	0.01 mg/m ³ N 0.1 ng-TEQ/m ³ N
	③	排気口 西No.2 (P0402)	真空加熱分離装置	PCB		0.000054 mg/m ³ N	0.000094 mg/m ³ N	0.1 mg/m ³ N	0.01 mg/m ³ N
				ダイオキシン類		0.0016 ng-TEQ/m ³ N	0.000028 ng-TEQ/m ³ N	-	0.1 ng-TEQ/m ³ N
				ベンゼン		<0.05 mg/m ³ N	<0.05 mg/m ³ N	-	0.35 mg/m ³ N
				アセトアルデヒド		-	0.02 ppm	-	0.1 ppm
				トルエン		-	0.1 ppm	-	0.1 ppm
				臭気排出強度		-	220 m ³ N/min	25 × 10 ⁶ m ³ N/min	-
	④	排気口 西No.3(P0201)	レベル3換排気 解体室	PCB ダイオキシン類		0.00017 mg/m ³ N 0.00084 ng-TEQ/m ³ N	0.000044 mg/m ³ N 0.0010 ng-TEQ/m ³ N	0.1 mg/m ³ N -	0.01 mg/m ³ N 0.1 ng-TEQ/m ³ N
	⑤	排気口 西No.4(P0202)	レベル3換排気 漏洩品解体準備室	PCB ダイオキシン類		0.00011 mg/m ³ N 0.00017 ng-TEQ/m ³ N	0.000021 mg/m ³ N 0.000021 ng-TEQ/m ³ N	0.1 mg/m ³ N -	0.01 mg/m ³ N 0.1 ng-TEQ/m ³ N
	⑥	排気口 西No.6-1 (P0203)	レベル2換排気 局所排気、除染処理室	PCB ダイオキシン類		0.000057 mg/m ³ N 0.000009 ng-TEQ/m ³ N	0.000020 mg/m ³ N 0.000009 ng-TEQ/m ³ N	0.1 mg/m ³ N -	0.01 mg/m ³ N 0.1 ng-TEQ/m ³ N
東棟	⑦	排気口 西No.6-2 (P0205)	レベル2換排気 抜油室	PCB ダイオキシン類		0.00014 mg/m ³ N 0.00045 ng-TEQ/m ³ N	0.000016 mg/m ³ N 0.000038 ng-TEQ/m ³ N	0.1 mg/m ³ N -	0.01 mg/m ³ N 0.1 ng-TEQ/m ³ N
	⑧	排気口 西No.7(P0204)	レベル1換排気	PCB ダイオキシン類		0.0000071 mg/m ³ N 0.000015 ng-TEQ/m ³ N	0.000019 mg/m ³ N 0.000030 ng-TEQ/m ³ N	0.1 mg/m ³ N -	0.01 mg/m ³ N 0.1 ng-TEQ/m ³ N
	-	ボイラー 排気口西No.5	窒素酸化物 ばいじん			42 ppm - g/m ³ N	51 ppm <0.001 g/m ³ N	150 ppm 0.05 g/m ³ N	60 ppm Trace
	①	排気口 東No.1-1(P0451)	高濃度ヘントガス	PCB ダイオキシン類		0.00036 mg/m ³ N 0.0053 ng-TEQ/m ³ N	0.00030 mg/m ³ N 0.0079 ng-TEQ/m ³ N	0.1 mg/m ³ N -	0.01 mg/m ³ N 0.1 ng-TEQ/m ³ N
	②	排気口 東No.1-2(P0452)	低濃度ヘントガス	PCB ダイオキシン類		0.00076 mg/m ³ N 0.022 ng-TEQ/m ³ N	0.00078 mg/m ³ N 0.029 ng-TEQ/m ³ N	0.1 mg/m ³ N -	0.01 mg/m ³ N 0.1 ng-TEQ/m ³ N
	③	排気口 東No.1-3(P0453)	脱気槽ヘントガスA	PCB ダイオキシン類	0.00071 mg/m ³ N 0.013 ng-TEQ/m ³ N	0.0046 mg/m ³ N 0.12 ng-TEQ/m ³ N	0.00059 mg/m ³ N 0.019 ng-TEQ/m ³ N	0.1 mg/m ³ N -	0.01 mg/m ³ N 0.1 ng-TEQ/m ³ N
	④	排気口 東No.1-4(P0454)	脱気槽ヘントガスB	PCB ダイオキシン類		0.00073 mg/m ³ N 0.013 ng-TEQ/m ³ N	0.0013 mg/m ³ N 0.084 ng-TEQ/m ³ N	0.1 mg/m ³ N -	0.01 mg/m ³ N 0.1 ng-TEQ/m ³ N
	⑤	排気口 東No.2-1 (P0457)	H ₂ ヘントガスA	PCB		0.000041 mg/m ³ N	0.000068 mg/m ³ N	0.1 mg/m ³ N	0.01 mg/m ³ N
				ダイオキシン類		0.006 ng-TEQ/m ³ N	0.00013 ng-TEQ/m ³ N	-	0.1 ng-TEQ/m ³ N
				塩化水素 ベンゼン	0.11 ppm 0.26 mg/m ³ N	0.16 ppm 420 mg/m ³ N	- -	- -	0.61 ppm 0.35 mg/m ³ N
	⑥	排気口 東No.2-2 (P0458)	H ₂ ヘントガスB	PCB		0.0000097 mg/m ³ N	0.000019 mg/m ³ N	0.1 mg/m ³ N	0.01 mg/m ³ N
				ダイオキシン類		0.000011 ng-TEQ/m ³ N	0.00012 ng-TEQ/m ³ N	-	0.1 ng-TEQ/m ³ N
				塩化水素 ベンゼン	0.35 ppm 0.05 mg/m ³	0.38 ppm 0.6 mg/m ³ N	- 450 mg/m ³ N	- -	0.61 ppm 0.35 mg/m ³ N
	⑦	排気口 東No.2-3 (P0456)	塩酸ヘントガスA	PCB		0.00012 mg/m ³ N	0.000089 mg/m ³ N	0.1 mg/m ³ N	0.01 mg/m ³ N
				ダイオキシン類		0.00016 ng-TEQ/m ³ N	0.000013 ng-TEQ/m ³ N	-	0.1 ng-TEQ/m ³ N
				塩化水素 ベンゼン	0.12 ppm 0.10 mg/m ³	1.6 ppm 1.7 mg/m ³ N	- <0.05 mg/m ³ N	- -	0.61 ppm 0.35 mg/m ³ N
	⑧	排気口 東No.2-4 (P0460)	塩酸ヘントガスB	PCB		0.0000073 mg/m ³ N	0.000031 mg/m ³ N	0.1 mg/m ³ N	0.01 mg/m ³ N
				ダイオキシン類		0.00001 ng-TEQ/m ³ N	0.000084 ng-TEQ/m ³ N	-	0.1 ng-TEQ/m ³ N
				塩化水素 ベンゼン	0.34 ppm <0.05 mg/m ³ N	0.09 ppm <0.05 mg/m ³ N	- -	- -	0.61 ppm 0.35 mg/m ³ N
	⑨	排気口 東No.4-1(P0253)	レベル2換排気 局所排気	PCB ダイオキシン類		0.0035 mg/m ³ N 0.003 ng-TEQ/m ³ N	0.00039 mg/m ³ N 0.00046 ng-TEQ/m ³ N	0.1 mg/m ³ N -	0.01 mg/m ³ N 0.1 ng-TEQ/m ³ N
	⑩	排気口 東No.4-2(P0251)	レベル2換排気 共通室、薬品室、洗浄室	PCB ダイオキシン類		0.000093 mg/m ³ N 0.000095 ng-TEQ/m ³ N	0.000057 mg/m ³ N 0.00014 ng-TEQ/m ³ N	0.1 mg/m ³ N -	0.01 mg/m ³ N 0.1 ng-TEQ/m ³ N
	⑪	排気口 東No.5(P0252)	レベル1換排気	PCB ダイオキシン類		0.000032 mg/m ³ N 0.000036 ng-TEQ/m ³ N	0.000048 mg/m ³ N 0.000041 ng-TEQ/m ³ N	0.1 mg/m ³ N -	0.01 mg/m ³ N 0.1 ng-TEQ/m ³ N
	⑫	排気口 東No.6-1 (P0455)	蒸留設備ヘントガスA	PCB		0.000022 mg/m ³ N	0.00045 mg/m ³ N	0.1 mg/m ³ N	0.01 mg/m ³ N
				ダイオキシン類		0.0025 ng-TEQ/m ³ N	0.0059 ng-TEQ/m ³ N	-	0.1 ng-TEQ/m ³ N
				塩化水素 ベンゼン	0.53 ppm 0.05 mg/m ³ N	0.15 ppm 3.2 mg/m ³ N	- -	- -	0.61 ppm 0.35 mg/m ³ N
	⑬	排気口 東No.6-2 (P0459)	蒸留設備ヘントガスB	PCB		0.000025 mg/m ³ N	0.000040 mg/m ³ N	0.1 mg/m ³ N	0.01 mg/m ³ N
				ダイオキシン類		0.00037 ng-TEQ/m ³ N	0.000097 ng-TEQ/m ³ N	-	0.1 ng-TEQ/m ³ N
				塩化水素 ベンゼン	0.49 ppm <0.05 mg/m ³ N	0.28 ppm 99 mg/m ³ N	- -	- -	0.61 ppm 0.35 mg/m ³ N
	-	ボイラー 排気口東No.3	窒素酸化物 ばいじん			48 ppm - g/m ³ N	53 ppm <0.001 g/m ³ N	150 ppm 0.05 g/m ³ N	60 ppm Trace

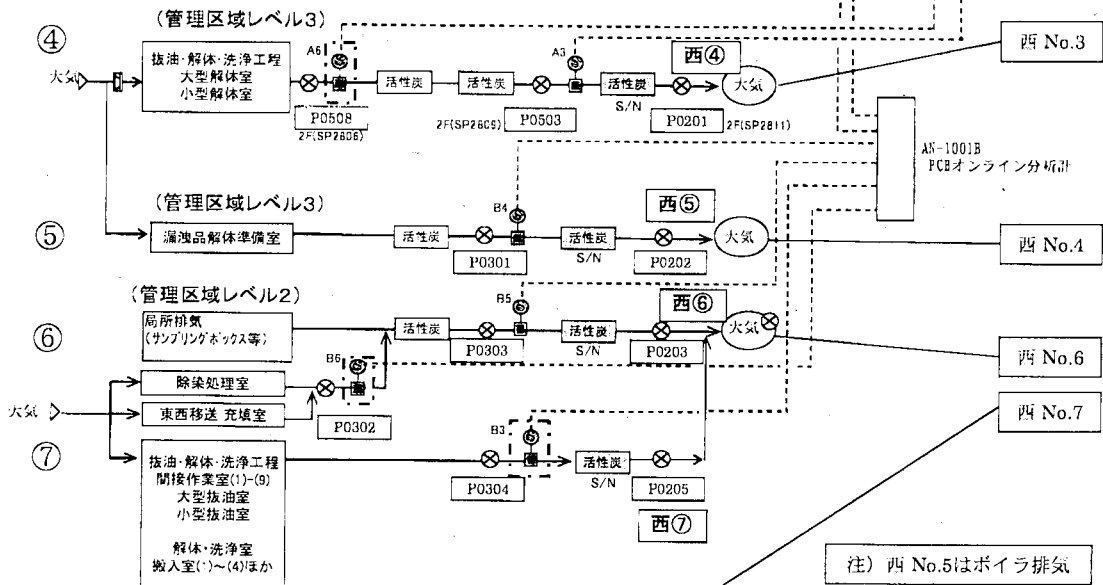
換排気処理工程図（西棟）

●PCBを取扱う設備の排気

排気系統番号



●作業空間の換気



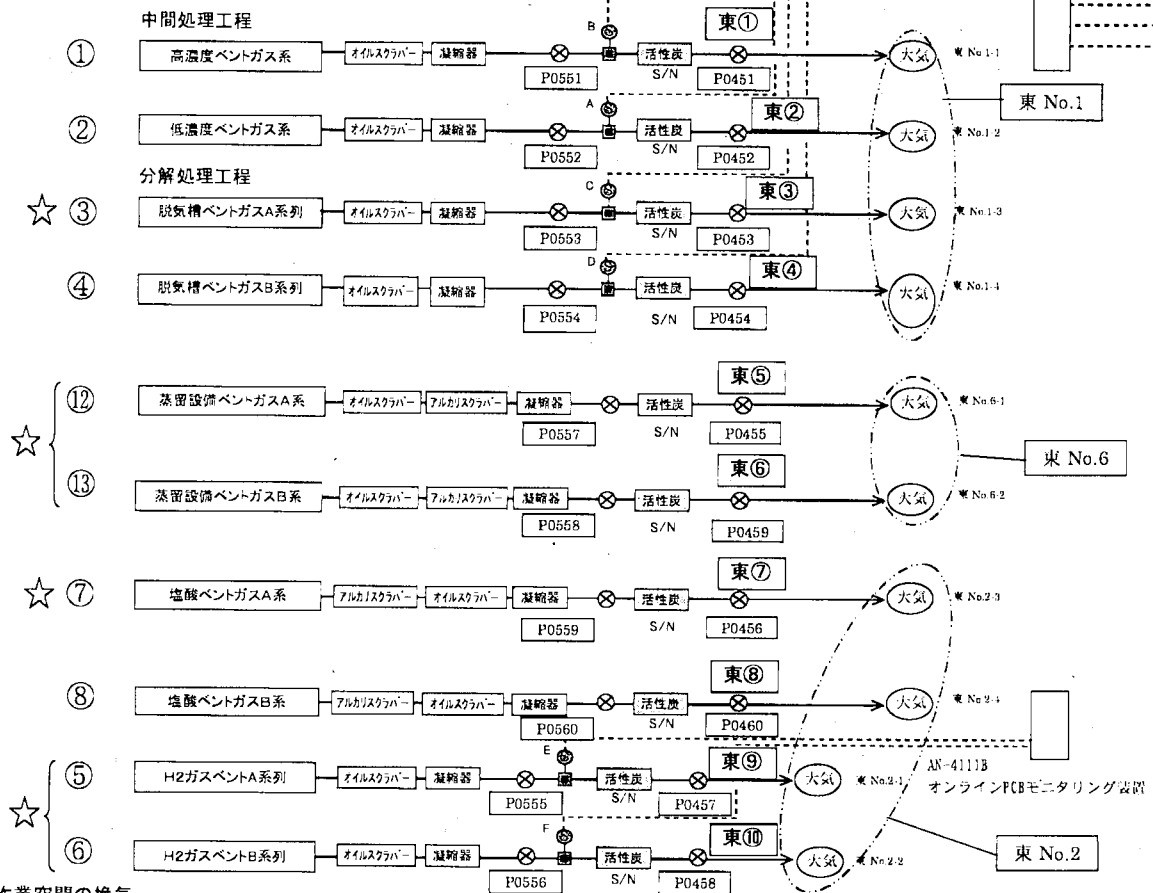
記号説明

⊗	オフラインモニタリング点(サンプリング口)
⊙	オンラインモニタリング点(プローブ管挿入)
⊙	作業環境オンラインモニタリング (プローブ管挿入)
○	排気口
P****	サンプリングポイントIDNo.
活性炭 S/N	セフティーネット活性炭フィルター
活性炭 脱臭	脱臭用活性炭フィルター

換排気処理工程図（東棟）

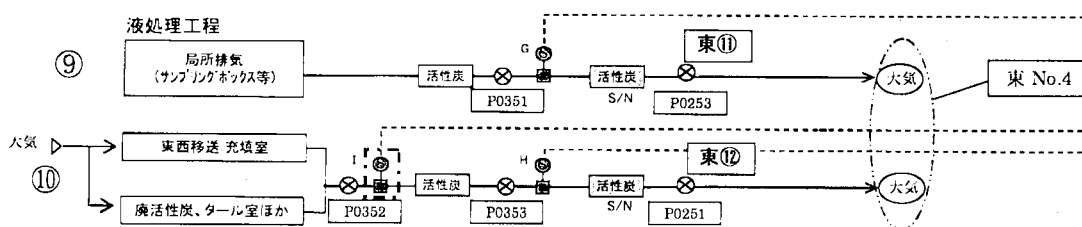
●PCBを取扱う設備の排気

排気系統番号

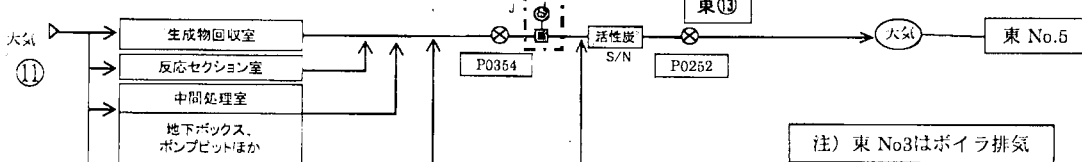


●作業空間の換気

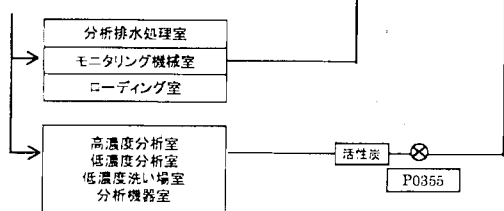
（管理区域レベル2）



（管理区域レベル1）



（一般PCB廃棄物取扱区域）



注）東 No.3はボイラ排気

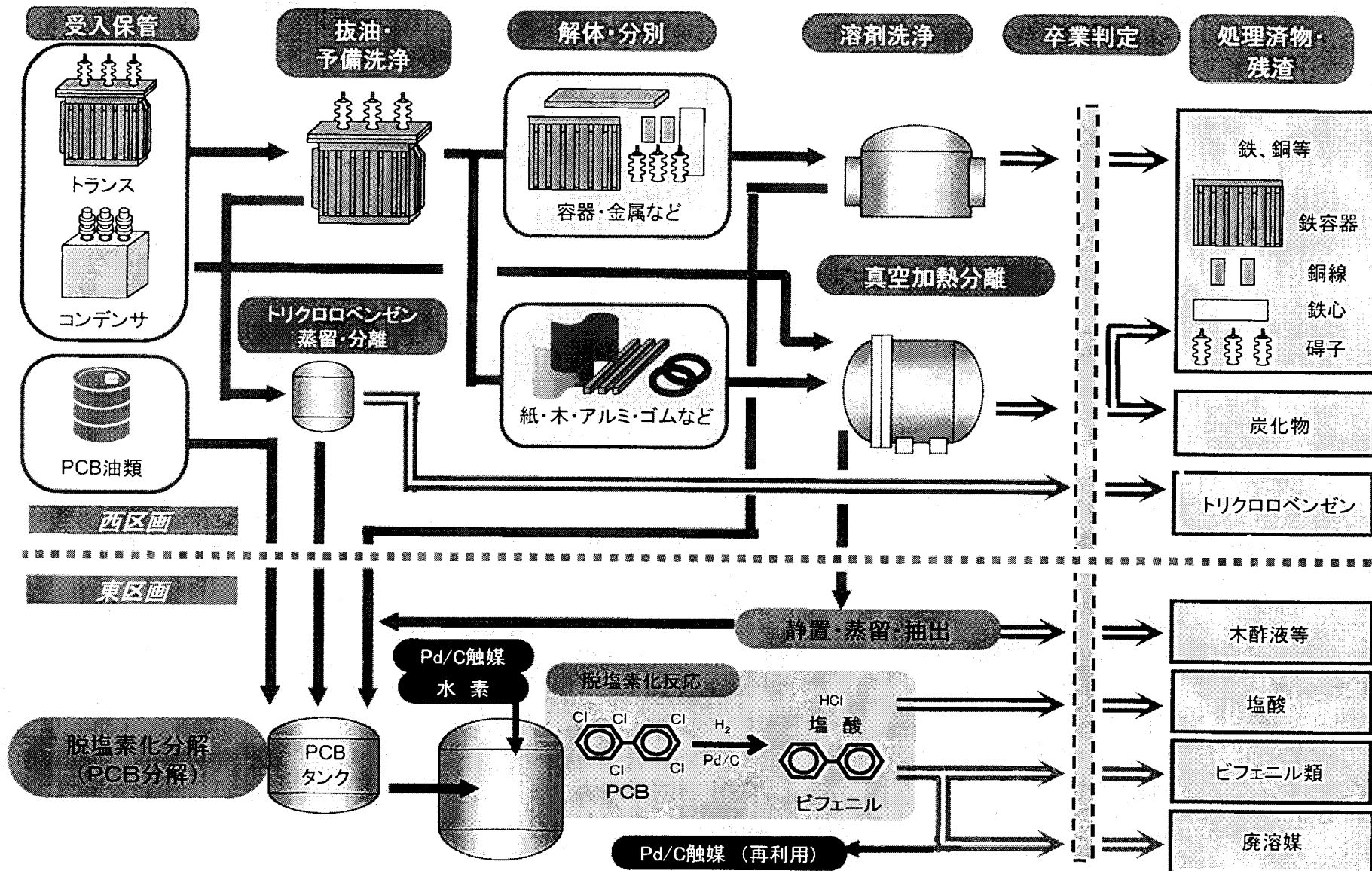
記号説明

⊗	オフラインモニタリング点(サンプリング口)
⊙	オンラインモニタリング点(プローブ管挿入)
⊙	作業環境オンラインモニタリング(プローブ管挿入)
⊙	排気口
P****	サンプリングポイントIDNo.
活性炭 S/N	セフティーネット活性炭フィルター
活性炭 脱臭	脱臭用活性炭フィルター

表-3. 悪臭、騒音・振動

棟名		測定項目		結果		維持管理値		自主管理目標値		
東西棟	騒音	騒音レベル	東	朝	55	dB	60	dB	-	
				昼間	58		65			
				夕	57		60			
				夜間	46		55			
			西	朝	53		60			
				昼間	59		65			
				夕	52		60			
				夜間	49		55			
			南	朝	57		60			
				昼間	60		65			
				夕	56		60			
				夜間	50		55			
			北	朝	57		60			
				昼間	62		65			
				夕	54		60			
				夜間	51		55			
	振動	振動レベル	東	昼間	32	dB	65	dB	-	
				夜間	31		60			
			西	昼間	<30		65			
				夜間	<30		60			
			南	昼間	36		65			
				夜間	30		60			
			北	昼間	31		65			
				夜間	<30		60			
	敷地境界 悪臭	臭気指数	東	<10	10	-	-	0.1	ppm	
			西	<10						
		アセトアルデヒド	東	0.003 ppm	0.05 ppm	-	-	0.1	ppm	
			西	<0.002 ppm						
トルエン		東	<0.9 ppm	10 ppm	-	-	-	-		
		西	<0.9 ppm							
西棟	真空加熱分離装置 排気口 西No.2(P0402)	アセトアルデヒド		0.02 ppm	-	-	0.1	ppm		
		トルエン		0.1 ppm	-	-	0.1	ppm		
		臭気排出強度		220 m³N/min	25 × 10⁶ m³N/min	-	-			

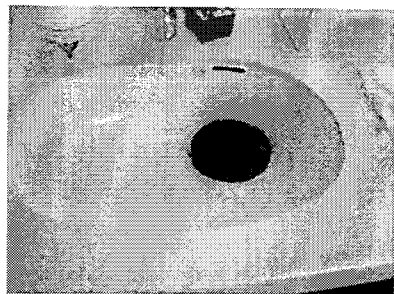
処理工程



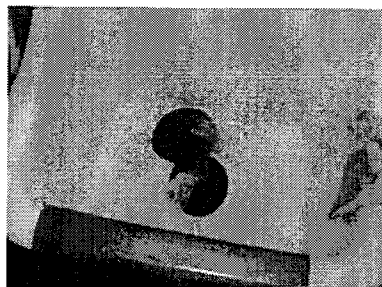
※Pd/C触媒とは活性炭の表面にパラジウムという金属を付着させたものです。

※残渣は、極力リサイクルします。

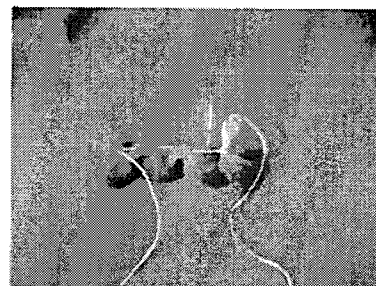
シンク、排水処理設備、雨水排水溝活性炭設置状況



シンク活性炭(250g)



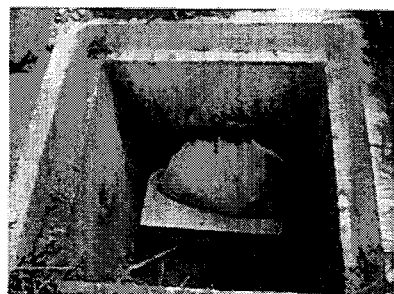
シンク活性炭(500g)



排水処理設備活性炭(1Kg)
(設置前)



排水処理設備活性炭(1Kg)
(設置後)



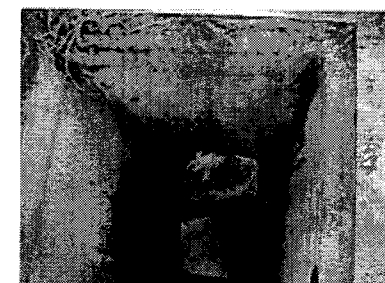
雨水排水溝活性炭(10Kg)



雨水排水溝活性炭(10Kg)



雨水排水溝活性炭(10Kg)



雨水排水溝活性炭(10Kg)

設置の方法

1. 各シンクは活性炭を250g～500g設置した。
2. 排水処理設備は西棟、東棟共活性炭を1Kg設置した。
3. 雨水排水溝は油水分離槽手前の会所でそれぞれ活性炭を10Kg設置した。